

中文科技资料目录

ZHONG WEN KE JI ZI LIAO MU LU

一九八六年第五期

上海科学技术文献出版社

中文科技资料目录

(1986年 第5期)

上海科学技术情报研究所 编

*

上海科学技术文献出版社出版

(上海市武康路2号)

新华书店经销 昆山亭林印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 18.75 字数 480,000

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数: 1—1,100

书号: 17192·117 定价: 3.25元

(限国内发行)

说 明

一、《中文科技资料目录》，双月刊，报道我所收藏的中文科技资料，按照《中国图书资料分类法》分类编目。

二、为了适应科技情报工作的需要，我所从1983年下半年开始，将国内专业会议资料(主要是应用科学方面的专业会议资料)缩摄成平片(平片规格148×105mm，每张平片缩摄98页资料)，这样做大大有利于资料的收藏和利用。

三、为了充分利用这些缩微平片资料，我所将为用户提供本期目录所报道的缩微平片的拷贝片，用户既可订购全套专业会议资料的平片，也可有选择地订购一个或几个专业会议资料的平片。每张平片1.20元，用户如有需要，请与我所中文资料室联系。平片清单见附录。

四、本目录分两部分，第一部分完整地反映每套专业会议资料的内容(按所有专业会议的名称进行分类排列，而每一个会议资料又按此会议资料的平片号排列)；第二部分根据每篇资料的学科内容进行分类排列，这样就便于用户从两个途径检索所需的资料。本目录除了反映我所收藏的原件的索取号外，还反映了平片的编号和坐标号，即平片号，这有利于用户组织排架和提供阅览。

五、本期目录报道的内容是我所第七批制作的50个专业会议的缩微平片资料，它也是我所馆藏中文缩微平片资料的专门目录。

六、著录格式使用说明：

TN407①

第二届集成电路测试学术会会议文集(二)②

(1—376 页)③

中国电子学会④82年⑤

索取号: 275730⑥

15D6⑦

① 按照“中资法”分类的分类号,如有两个类号则表示此资料同时在两个类目中反映;

② 资料名称;

③ 资料页数;

④ 出版单位(或个人作者);

⑤ 出版日期;

⑥ 原件索取号;

⑦ 平片号,“15”为编号,“D6”为坐标号。如有两个平片号,则表示此资料同时在两个专业会议中交流。

上海科学技术情报研究所

一九八六年十月

目 录

(一) 按会议排

1. 中国计量测试学会光辐射 1984 年讨论会 1984 年 10 月在乐山召开	1
2. 全国第二届薄膜技术讨论会 1985 年 2 月在北京召开	2
3. 全国第二届光学薄膜技术交流会 1984 年 10 月在南京召开	8
4. 全国热物理性能学术交流会 1984 年 11 月在大连召开	11
5. 中国计量测试学会振动、冲击、转速技术交流会 1984 年 10 月在上海召开	14
6. 中国光学学会全国第一次全息摄影交流会 1984 年 11 月的北京召开	18
7. 中国计量测试学会 1984 年全国流量学术讨论会 1984 年 10 月在辽阳召开	20
8. 中国航空学会透射电镜显微分析及定量金相学术交流会 1984 年 9 月在歙县召开 ..	22
9. 中国金属学会理化检验第二届短时力学学术交流会 1985 年 6 月在桂林召开	24
10. 全国第三届渗硼学术讨论会 1985 年 4 月在蓬莱召开	27
11. 中国航空学会铸造高温合金学术会议 1984 年 6 月在黄山召开	29
12. 中国航空学会铸造铝镁合金材料及工艺交流会 1984 年 7 月在沈阳召开	31
13. 上海机械学会 1984 年年会 1984 年 12 月在上海召开	33
14. 中国航空学会齿轮减速器交流会 1984 年 10 月在厦门召开	37
15. 中国机械学会第二届液压气动技术交流会 1984 年 11 月在镇海召开	39
16. 中国仪器仪表学会过程检测控制学会第二届仪表系统及应用交流会 1985 年 1 月在 上海召开	47
17. 中国仪器仪表学会仪表焊接技术及其测试技术学术交流会 1984 年 10 月在武夷山 召开	49
18. 上海内燃机学会 1984 年年会 1984 年 12 月在上海召开	51
19. 中国内燃机学会大功率柴油机结构与结构强度交流会 1984 年 12 月在无锡召开	53
20. 全国同位素技术应用交流会 1985 年 1 月在上海召开	54
21. 中国航空学会继电器、接触器交流会 1984 年 11 月召开	56
22. 中国电机学会、中国机械学会机组调峰学术会议 1985 年 7 月在承德召开	58
23. 第六届全国红外科技交流会 1984 年 11 月在洛阳召开	62
24. 全国激光技术研讨会 1984 年 6 月在厦门召开	67
25. 全国激光基本问题讨论会 1985 年 5 月在苏州召开	68
26. 中国电子学会通信学会微波通信技术会议 1984 年 9 月在泉州召开	70
27. 中国航空学会仿真技术交流会 1984 年 11 月在南京召开	76
28. 中国仪器仪表学会过程检测控制学会第二届执行器学术交流会 1984 年 10 月在合肥 召开	79

29. 中国计算机学会计算机振兴研讨会 1984年 11 月在厦门召开.....	80
30. 第一次全国计算机技术培训学术交流会 1984 年 4 月在苏州召开	84
31. 中国电子学会计算机学会结构工艺第二届年会 1984 年 7 月在成都召开	86
32. C 语言认识交流会 1984年 11 月在苏州召开.....	88
33. 全国第二届四位机应用成果交流会 1984年 11 月在温州召开.....	90
34. 电子部计算机应用经验交流会 1985 年 3 月在成都召开	91
35. 全国第二届非数值应用学术交流会 1985 年 3 月在成都召开	95
36. 中国仪器仪表学会过程控制学会第一届气动技术交流会 1985 年 4 月在常州召开 ...	98
37. 中国航空学会工程塑料交流会 1984年 10 月在成都召开.....	99
38. 中国化工学会橡胶学会天然橡胶加工应用技术讨论会 1984 年 4 月在湛江召开	101
39. 中国化工学会化肥学会第 24 次复肥与混肥交流会 1984 年 11 月在柳州召开	103
40. 上海纺织学会印染 1984 年年会 1984 年 11 月在上海召开	106
41. 中国纺织学会 1984 年全国染整新技术革命学术讨论会 1984 年 10 月在上海召开 ...	113
42. 中国电子学会空气净化学术年会 1984年 11 月在天津召开.....	119
43. 第八届全国高层建筑结构学术交流会 1984 年 5 月在屯溪召开	121
44. 中国铁道学会蒸汽机车节能学术讨论会 1984年 10 月在昆明召开.....	124
45. 中国铁道学会高原地区内燃机车运行学术交流会 1984 年 8 日在乌鲁木齐召开	125
46. 中国造船学会动力装置交流会 1984 年 9 月在大连召开	126
47. 中国造船学会涡轮机交流会 1984 年 9 月在厦门召开	127
48. 中国造船学会船舶材料工艺理化测试交流会 1984年 10 月在洛阳召开.....	129
49. 中国航空学会航空电气开关第二次年会 1984 年 5 月在福州召开	131
50. 中国航空学会叶片检测会议 1984年 10 月召开.....	132

(二) 按专业排

C 社会科学总论.....	136
E 军事.....	136
F 经济.....	138
G 文化、科学、教育、体育	141
O 数理科学和化学.....	142
P 天文学、地球科学	150
Q 生物科学	150
R 医药、卫生.....	151
S 农业科学.....	151

T	工业技术	153
TB	一般工业技术	153
TD	矿业工程	159
TE	石油、天然气工业	159
TF	冶金工业	160
UF	金属学、金属工艺	160
TH	机械、仪表工业	182
TJ	武器工业	200
TK	动力工程	201
TL	原子能技术	207
TM	电工技术	207
TN	无线电电子学、电信技术	218
TP	自动化技术、计算技术	238
TQ	化学工业	253
TS	轻工业、手工业	262
TU	建筑科学	277
TV	水利工程	281
U	交通运输	281
V	航空、宇宙飞行	286
X	环境科学	293

按会议排

中国计量测试学会光辐射 1984年讨论会 1984年10月在乐山召开

视觉研究与光度学的未来发展 (14 页)

中国计量科学研究院 84.8

索取号: 307309

3428A1

HYF-1A 型红外辐射探测器 (10 页, 附图)

上海技术物理研究所 84.10

索取号: 307318

3428B2

光积分球辐射率的标定及其同轴有限距离平
面上的辐射量的解析计算 (5 页)

上海技术物理研究所 84.10

索取号: 307326

3428C3

温度连续调节的大孔径常温黑体辐射源
(11 页, 附图)

中科院空间物理研究所 84.9

索取号: 307333

3428C10

色敏器件在色差及光源测量中的潜在应用
(10 页)

武汉大学 84.10

索取号: 307335

3428D12

双光束非线性测定仪 (9 页)

中国计量科学研究院 84.8

索取号: 307311

3428E12

微弱光度标准装置 (9 页)

北京师范大学 84.10

索取号: 307337

3428F7

用 BC3-80 微型机对光谱辐射计作实时控制
和数据处理 (9 页)

中国计量科学研究院 84.8

索取号: 307313

3428G3

光谱响应测试中一个新的双光束方案 (8 页)

北京师范大学

索取号: 307336

3429A1

150-350 间氩等离子体连续光谱系数的测量
(12 页)

长春光学精密机械研究所 84.10

索取号: 307323

3429A9

红外线灯泡全辐射通量测试的误差分配与综
合

全国电光源工业产品质量检测
中心西南站 84.9

索取号: 307327

3429B9

微机色温仪 (15 页)

北京标准计量局

索取号: 307330

3429C6

数字式光强色温计的研制 (24 页)

中国计量科学研究院 84.8

索取号: 307339

3429D7

漫射壁圆筒~双锥型黑体空腔有效发射率计
算 (12 页)

航天部第三研究院 84.9

索取号: 307334

3429F4

脉冲激光能量的准确测量 (7 页)

索取号: 307320

3430A1

照明器的配光曲线和光效率的测试方法
(10 页)

辽宁测试技术研究所
索取号: 307316 3430A8

CIE 技术报告——光辐射探测器光谱响应的
测定 (61 页)

中国计量科学研究院 84.3
索取号: 307338 3430B5

硅光电二极管使用中有关噪声问题的考虑
(15 页)

中国计量科学研究院 84.8
索取号: 307310 3430F11

镀膜型激光中功率计面积均匀性响应瞬态特
性和测量 (5 页)

中国计量科学研究院 84.8
索取号: 307328 3431A1

应用微机 Cromenco-Ⅱ 实现光源和接收器
的长期稳定性考查 (9 页)

成都计量测试研究院
索取号: 307329 3431A8

辐射定标中光栏温升误差的估计 (5 页)

成都计量测试研究院 84.9
索取号: 307332 3431B4

高精度激光稳功率系统 (8 页, 附图)

成都计量测试研究院
索取号: 307308 3431B10

带有微型计算机的颜色测量系统 (7 页)

武汉光学科技研究所 84.10
索取号: 307322 3431C5

Cr20Ni80 合金氧化表面发射率的测量 (6 页)
辽宁计量测试技术研究所 84.9

索取号: 307317

3431C13

矿井安全标志逆反射材料的特性测试 (8 页)

辽宁计量测试技术研究所
索取号: 307307 3431D6

PLEM-1 型热释电激光能量计 (12 页)

重庆市光学机械研究所
索取号: 307319 3431E1

新型光辐射探测器简介 (5 页)

上海嘉定学联仪表厂 84.10
索取号: 307315 3431E13

中间视觉光效率函数的测量研究 (12 页)

中国计量科学研究院 84.8
索取号: 307314 3431F5

采用国产微型计算机的月掩星快速光度记录
设备 (14 页, 附图)

上海天文台 84 年
索取号: 222695 3432A1

紫外光谱辐射计的控制数据采集和处理
(11 页)

中国计量科学研究院 84.8
索取号: 307312 3432B3

光电器件频率特性的测试 (12 页)

电子部四十四研究所
索取号: 307325 3432C1

苏联红外辐射度学进展概述 (4 页)

上海技术物理研究所
索取号: 307331 3432C14

全国第二届薄膜技术
学术讨论会

1985年2月在北京召开

基片刚度对铝膜发灰的影响 (11 页)

- 清华大学 北京仪器厂 84.10
索取号: 307488 3303A1
- 光学薄膜科学与技术的一些新进展(8 页)
北京电影机械研究所 北京玻璃研究所
84.12
索取号: 307412 3303A13
- 磁控溅射技术在平板型整流元件制造中的应用(8 页)
北京变压器厂 85.1
索取号: 307449 3303B9
- 在二氧化锰/二氧化铅半导体薄膜研制中应用电子能谱分析
航天部 804 研究所 上海测试技术研究所
索取号: 307424 3303C4
- MIC 与真空镀膜技术(9 页)
电子部第九研究所 84.12
索取号: 307464 3303C10
- 三极离子镀铝(10 页)
北京工业大学 84.9
索取号: 307404 3303D6
- ICP-AES 法对薄层组分分析的应用(12 页)
长春物理研究所 84.12
索取号: 307408 3303E4
- 用离子束混合技术改进钢表面性能(10 页)
天津师范大学 84.12
索取号: 307405 3303F3
- 关于 ZnO 直流平面磁控反应溅射靶的氧化研究(8 页)
上海硅酸盐研究所 84.12
索取号: 307423 3303F13
- 用原子层外延(ALE)方法在玻璃衬底上生长 ZnS 单晶薄膜(9 页)
长春物理研究所 84.12
索取号: 307406 3303G8
- 在塑料衬基上研制透明导电膜(9 页)
长春物理研究所 84.9
索取号: 307476 3304A4
- 苯乙烯等离子体聚合规律及聚合膜的性能(8 页,附图)
长春应用化学研究所 84.12
索取号: 307407 3304A14
- 非晶形铁的氧化物薄膜的激光化学沉积(5 页)
上海激光技术研究所 84.12
索取号: 307425 3304B13
- DLK-800 空心阴极离子镀膜机的研制(4 页)
北京仪器厂 84.12
索取号: 307463 3304C5
- 硅基片镀 3.2-4.9 微米高强前截止型滤光片
昆明物理研究所 84.12
索取号: 307416 3304C10
- 我厂金属镀膜制造工艺(5 页)
福建光学仪器厂 84.12
索取号: 307456 3304D4
- 磁控溅射压电陶瓷铜电极研究(4 页)
北京仪器厂 84.11
索取号: 306868 3304D10
- 超薄金属膜厚度的测量(6 页)
复旦大学 84.12
索取号: 307434 3304E1
- 一个改进的真空镀膜系统和 IETS(13 页)

- 索取号: 307409 复旦大学 3304E9 扩散炉型等离子增强化学汽相沉积氮化硅薄膜(7页)
- H46500-2型双室磁控溅射设备的研制(4页) 上海元件五厂 3305E6
南光机器厂 84.12
- 索取号: 307420 3304F8 LPCVD N⁺和P⁺高电导多晶硅薄膜制备工艺(7页)
- ZnSe单晶薄膜的MOCVD法生长(14页) 北京半导体器件研究所 84.12
长春物理研究所 84.12
- 索取号: 307468 3304F13 索取号: 307473 3305E13
- 透明导电膜的制备和应用概况(8页) 过量PbO的PbTiO₃陶瓷靶料对溅射PbTiO₃膜的影响(10页)
- 东北工学院表面研究所 84.12 上海硅酸盐研究所 84.12
- 索取号: L8786 3305A1 索取号: 307458 3305F7
- 八匝薄膜磁头研究初探(3页,附图) 太阳反光膜研制(9页)
- 中科院计算技术研究所 84.10 北京仪器厂 84.12
- 索取号: 307448 3305A10 索取号: 307443 3305G4
- 磁控溅射S-枪在MOS电路上的应用(3页) 化学气相沉积(CVD)法制备薄膜材料的进展(16页)
- 浙江大学 84.11 中国科学院电子研究所 84.11
- 索取号: 307492 3305B1 索取号: 307442 3306A1
- 真空蒸镀光学彩色膜的研究(6页) TiN离子镀层的应力测定(14页)
- 暨南大学 84.12 清华大学 84.8
- 索取号: 307478 3305B5 索取号: 307438 3306B4
- 蒸镀薄膜的生长机理(6页) 二氧化钛掺杂蒸镀技术
- 东北工学院表面研究所 84.12 哈尔滨电影机械厂 84.12
- 索取号: 307428 3305B12 索取号: 307451 3306C3
- 氮化硅膜的电导和存储性能(11页) 注入铟离子的ZnS薄膜的交流电致发光(10页)
- 暨南大学 吉林大学 长春物理研究所 84.12
- 索取号: 307470 3305C5 索取号: 307422 3306C11
- 氮化钛涂层显微组织及其界面的研究(9页,附图) 中科院金属研究所 84.10
- 索取号: 307454 3305D4 小型碳膜电阻器电阻薄膜的电子能谱分析(18页)

- 天津大学 84.12
索取号: 307445 3306D9
- 激光诱导局域生长 SiO_2 膜 (11 页)
索取号: 307437 河北大学 3306F5
- 三极反应溅射主要参数之间函数关系的初步探讨 (15 页)
天津热处理工艺研究所 84.4
索取号: 307483 3306G4
- 激光生成钼硅化物的研究 (9 页, 附图)
索取号: 307431 上海建筑材料工业专科学校 3307A5
- Cr-Si 薄膜电导性能研究 (8 页)
索取号: 307411 复旦大学 84.12 3307B6
- 三氧化二铬的镀制及其性质的初步研究 (6 页)
暨南大学 84.12
索取号: 307410 3307C1
- 真空蒸镀薄金属铝膜厚度及光学常数的偏振测量
索取号: 307480 暨南大学 84.12 3307C10
- 膜厚控制仪量程扩展 (2 页, 附图)
索取号: 307489 电子部工艺研究所 84.12 3307D1
- 用于干涉显微镜测量航空玻璃导电膜膜厚 (7 页)
索取号: 294503 建材研究院玻璃一所 84.12 3307D6
- HCD 法氮化钛膜层超硬刀具的研制 (18 页)
- 沈阳真空技术研究所 84.10
索取号: 307477 3307E3
- TiN 膜层的定性相分析 (9 页)
索取号: 307439 清华大学 3307F8
- 化学气相沉积和高性能防护涂层 (19 页)
兵器部第五四研究所 84.12
索取号: 307429 3307G2
- FS-46 氟塑管在 CVD 及外延管路系统中的应用 (6 页)
索取号: 307403 4435 厂 84.12 3308A8
- 气流模型角度对 LPCVD Si_3N_4 膜厚度均匀性的改进 (4 页)
索取号: 307417 878 厂 84.12 3308B1
- DL-700 型真空离子镀膜设备及工艺 (9 页)
索取号: 307466 兰州真空设备厂 84.12 3308B10
- 一种新型结构的等离子 CVD 设备 (9 页)
索取号: 307484 山东威海无线电三厂 84.10 3308C9
- 宽带增透膜的研制及其应用 (摘要) (9 页)
索取号: 307444 上海机械学院 84.12 3308D6
- 常压 CVD 硼掺杂 P^+ 多晶硅薄膜的制备和性质 (10 页)
索取号: 307450 北京半导体器件研究所 84.12 3308E2
- 关于 BAK700 镀膜机的使用与分析 (5 页)

- 717 研究所 84.12
索取号: 307482 3308E13
人造超晶格和薄层外延技术(8 页)
长春物理研究所 84.10
索取号: 307446 3309E4
- 平面磁控溅射用于集成电路制造工艺(10页)
上海元件五厂
索取号: 307440 3308F6
刀片刃口沉积合金层(10 页)
上海刀片厂 上海日用五金工业研究所
84.12
索取号: 307453 3309E14
- 通用膜系计算程序设计
8358 研究所
索取号: 307427 3308G2
薄膜制备的一种新技术——聚焦重离子束溅射技术(7 页)
中国原子能科学研究院 84.12
索取号: 307433 3309F11
- 直流磁控反应溅射薄膜的沉积参数、化学组成与光学常数(2 页)
清华大学 84.10
索取号: 307491 3309A1
 $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$ 透明导电膜的研究与应用(5 页)
航空部 3137 厂 84.12
索取号: 307487 3309G7
- 大面积($500 \times 1600\text{mm}^2$) 真空镀 PbS/Al/Al 太阳能选择性吸收涂层的研制(17 页)
陕西师范大学 84.10
索取号: 307467 3309A4
RIE-SiO₂ 的机理及剖面控制(10 页)
复旦大学 84.12
索取号: 307465 3310A1
- AgCL/Si₃N₄ 膜的制备及其应用(8 页)
江西大学 84.10
索取号: 307435 3309B7
用离子镀膜方法研制太阳灶反射膜(10 页)
清华大学 北京太阳能研究所 84.10
索取号: 307452 3310A12
- 蒸发薄膜电极对高聚物电性能测量的影响(14 页)
上海交通大学 84.12
索取号: 307462 3309C2
氮离子注入隐埋氮化硅膜的剖析(7 页)
江西大学
索取号: 307474 3310B8
- 石英晶体测厚在电子束镀膜中的应用(5 页)
南光机器厂 84.12
索取号: 307419 3309D3
CuBe(O) 二次发射体表面薄膜的生长与剖面分析(4 页)
华北第三研究院 北京核仪厂 84.10
索取号: 307432 3310C1
- 由 CVD 到 PECVD 研究等离子体在薄膜生长中的作用(8 页)
南京大学 84.12
索取号: 307421 3309D9
单片集成电路上应用的薄膜电阻(4页,附图)
电子部二十四研究所 84.8
索取号: 307457 3310C6

- 用于硅太阳能电池的高折射率减反射膜(12页)
电子部十八研究所 84.12
索取号: 307430 3310C13
- 仿金装饰离子镀层的色调研究(6页,附图)
上海钢铁研究所工艺技术分所 84.10
索取号: 307485 3310D12
- 氮化钛膜层刀具经济效益分析(3页)
沈阳真空技术研究所 84年
索取号: 307490 3310E5
- 氮化钛膜层刀具性能分析(13页)
沈阳真空技术研究所 84.10
索取号: 307479 3310E9
- 一种高速率磁控溅射源——磁增强型S-枪
(9页)
浙江大学 84.9
索取号: 307415 3310F9
- “低温”蒸发—氧化硅工艺(4页)
航空部 607 研究所 84.12
索取号: 307481 3310G5
- 原子层(ALE)沉积 InSe 单晶薄膜技术和离子注入 B、In、Er 的性能(9页)
长春物理研究所 84.12
索取号: 307469 3311A1
- HCD 法离子镀 TiN 涂层及其摩擦磨损行为的研究(8页,附图)
中科院金属研究所 84.12
索取号: 307455 3311A11
- LPCVD 法磷掺杂多晶硅工艺(6页)
机械部自动化研究所 84.12
索取号: 307471 3311B12
- SiO₂ 辐射致冷薄膜表面的光谱选择(11页)
南京大学
索取号: 307418 3311C5
- 低频 C7F14-O₂ 等离子体中 SiO₂ 和 Si 的平板刻蚀特性(6页)
北京半导体器件研究所 84.12
索取号: 307414 3311D3
- 极值法控制膜厚精度的分析及保证措施(7页)
河北工学院 84.12
索取号: 307436 3311D10
- 涂胶—曝光—显影工艺过程对多晶硅刻蚀特性的影响(5页)
北京半导体器件研究所
索取号: 307413 3311E4
- 空心阴极离子镀氮化钛工艺研究(18页)
大连工学院
索取号: 307459 3311E9
- S-枪磁控溅射技术在陶瓷金属化中的应用(6页)
浙江大学 84.9
索取号: 307461 3311F13
- PCVD 法制 TiN 膜用于提高高速钢刀具寿命试验(5页)
青岛化工学院 84.12
索取号: 307460 3312A1
- HCD 法离子镀 Cr-N 工艺研究(10页)
电子部工艺研究所 84.12
索取号: 307486 3312A7
- 铝—镁合金膜的制备及性质、结构的研究(17页)

长春光学精密机械研究所 85.1
索取号: 307447 3312B4

SiPOS 薄膜及其在半导体器件中的应用
(10 页)

华东师范大学 84.12
索取号: 307472 3312C9

正交试验法优选 LPCVD 最佳工艺(10 页)
709 研究所 84.12

索取号: 307426 3312D6

全国第二届光学薄膜 技术交流会

1984年10月在南京召开

中性光谱的图形渐变分光膜的研制(12 页,
附图)

福建师范大学激光研究所 84.10
索取号: 307292 3255A1

微机用于霍耳测试数据的实时处理(8 页)
电子部十一研究所 84.11

索取号: 305804 3255A13

近红外长波通滤光片的研制(6 页)

上海航天局 803 研究所 84.6
索取号: 307255 3255B2

光学薄膜厚度控制技术——采样比较法的探
讨(22 页)

兵器部五十八研究所 84.9
索取号: 307263 3255B8

激光驱动冲击波实验用靶的工艺小结

成都 523 信箱
索取号: 307287 3255E6

掺杂对光学薄膜性能的影响(21 页)
国防科技大学 84.11

索取号: 307262 3255E12

非 $\frac{\lambda}{4}$ 膜系的极值控制法(12 页)

成都科学仪器厂 84.11
索取号: 307261 3255G6

截止限从 X 射线到远红外的可见区窄带干涉
滤光片的制备

杭州光学仪器厂
索取号: 307258 3256A5

染料片 1.06μ 的高效增透膜(6 页)

曙光仪器厂 84.9
索取号: 307290 3256A11

光学透明薄膜折射率色散的测量(9 页)

兵器部 209 研究所
索取号: 307264 3256B4

光学薄膜膜系设计的一种快速优化方法
(16 页,附图)

长春光学精密机械研究所 84.10
索取号: 307285 3256C2

矢量图解法关于最佳激光增透膜系的分析
(11 页)

国防科技大学 84.10
索取号: 307289 3256D6

高功率 CO_2 连续激光镀膜研究(5 页)

蔡一鸣
索取号: 307286 3256E4

法布里—珀罗全介质型窄带干涉滤光片的镀
制

南京华东光学仪器厂 84.10
索取号: 253916 3256E10

- 椭圆柱形可控谱带介质聚光腔的研制(9页)
哈尔滨工业大学 84.9
索取号: 307294 3256F5
- 用于航天摄影的多谱段分光系统(8页)
哈尔滨工业大学 84.10
索取号: 288606 3256G1
- 多层微量吸收介质膜反射镜的极限吸收率
(8页)
哈尔滨科技大学
索取号: 307268 3256G10
- 双向磁偏转电子枪及镀膜参数的控制(10页,
附图)
王任贵
索取号: 307288 3257A4
- 金属介质高反膜(12页)
大连化学物理研究所 84.10
索取号: 307283 3257B1
- 热处理对多层膜的微观结构和性质的影响
(10页)
北京玻璃研究所 84.10
索取号: 307281 3257C1
- 宽带高增透膜的简易设计方法(5页)
哈尔滨工业大学 84.10
索取号: 307266 3257C12
- 窄带滤光片研究——带宽探讨(17页)
天津 8358 研究所
索取号: 307254 3257D3
- 光学镀膜用 $ZrTiO_4$ 的物化性质(11页)
北京有色金属研究总院 84.10
索取号: 307282 3257E7
- 眼底荧光血管造影摄象机滤光片(17页,附图)
福建师范大学激光研究所 84.10
索取号: 307256 3257F5
- 多层调制膜的进展(16页)
复旦大学
索取号: 307270 3258A1
- 用于红外分析器的二种红外滤光片镀制工艺
(9页)
北京分析仪器厂研究所 84.7
索取号: 307302 3258B3
- 紫外双层金属诱增透滤光片(6页,附图)
上海光学仪器研究所 84.11
索取号: 307251 3258C1
- 几种红外增透膜(9页)
大连化学物理研究所 84.10
索取号: 307300 3258C9
- 分光膜的评价标准以及补偿偏振影响的辅助
措施(12页)
新天光学仪器研究所
索取号: 307272 3258D6
- 混合膜料及其应用(7页)
长春光机学院 84.10
索取号: 307271 3258E4
- WFF30型低反射率测量简介(5页)
北京光学仪器厂
索取号: 307299 3258E12
- 9~11 μ 红外带通滤光片(3页,附图)
国家海洋局海洋技术研究所 84.9
索取号: 307249 3258F4
- V型增透膜的监控方案探讨(6页)

